<<真空微电子学及其应用>>

图书基本信息

书名: <<真空微电子学及其应用>>

13位ISBN编号:9787810509152

10位ISBN编号: 7810509152

出版时间:2002-4

出版时间:东南大学出版社

作者:王保平编

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

<<真空微电子学及其应用>>

内容概要

真空微电子学是一门新兴交叉学科,涉及到真空电子学、微电子学、薄膜技术和材料科学等多门学科和技术。

本书从真空微电子学的形成、发展历史和最新动态出发,系统地介绍了真空微电子学的物理基础,即场致发射理论和其他相关物理原理,详细地讨论了微细结构制造技术、真空微电子器件工作特性的数值模拟和器件结构设计,着重阐述了真空微电子学的应用及其对未来电子学发展的巨大影响。

本书可作为高等院电子信息技术、通信技术、微电子学及相关专业的高年级本科生教材,也可供从 事真空微电子学研究与开发的专业技术人员参考。

<<真空微电子学及其应用>>

书籍目录

1 绪论 1.1 引言 1.2 真空微电子学的发展历史 1.3 真空微电子学的特点和内容 1.4 真空微电子学的应用与发展趋势 思考题与习题 参考文献 2 场致发射 2.1 引言 2.2 表面电子特性 2.3 金属场致发射 2.4 半导体场致发射 2.5 内场致发射 2.6 场致发射电子的能量分布和Nottingham效应 2.7 空间电荷效应 思考题与习题 参考文献 3 器件物理与特性分析 3.1 引言 3.2 场致发射公式的特性 3.3 真空条件和FEA结构分析 3.4 FEA结构优化和理论极限 3.5 FEA热稳定性和材料选择 3.6 FEA阵列特性估算 思考题与习题 参考文献 4 数值计算与器件特性模拟 4.1 引言 4.2 数值计算模型的建立 4.3 静电场的数值模拟 4.4 电子轨迹及发射电流的计算 4.5 场致发射器件特性模拟 思考题与习题 参考文献 5 器件制造与工艺 5.1 引言 5.2 纵向器件的制备 5.3 横向器件的制备 5.4 器件封装 5.5 器件制备中所涉及的重要工艺 思考题与习题 参考文献 6.5 场致发射显示屏 6.6 传感技术 6.7 显微技术 思考题与习题 参考文献

<<真空微电子学及其应用>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com